

# クリーンルーム使用許可申請書

No. \_\_\_\_\_

申請者氏名*	学科	研究室名	責任者印
			研究室
内線番号	メールアドレス	使用希望時間	
		1限	
申請依頼日	使用希望日	2限	
		3限	
年 月 日	年 月 日	4限	

使用機材	型名	使用ガス
スピコータ 1	1H-D7 (MIKASA)	①
スピコータ 2	MS-A100 (MIKASA)	②
スピコータ 3	MS-A100 (MIKASA)	③
定温乾燥機 1	DX300 (ヤマト科学)	④
定温乾燥機 2	DX300 (ヤマト科学)	⑤
1200°Cチューブ炉	KTF047 (光洋リンドバーグ)	
1100°Cチューブ炉	KTF047 (光洋リンドバーグ)	
蒸着装置(抵抗加熱)	SVC-700 (サンヨー電子)	
DCスパッタ装置	SVC-700TMSG(サンヨー電子)	
純水製造装置	WG250 (ヤマト科学)	
ダイシングソー	DAD321 (DISCO)	
マスクアライナ	PLA501S (CANON)	
反射分光膜厚計	FE-3000	
TEOS-CVD	PD220L	
ドライエッチング	CSE-1110	
RFスパッタ	SVC-700RFI	
プラズマリアクタ	PR301	
高真空蒸着装置	SBHCU-8P	

  

使用薬品
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

\*共同実験者がいる場合は、氏名を備考欄に記載すること

備考：

注：実験計画書（実験内容を記載したもの）を添付のこと